

ガス種	目的	アプリケーション	特徴	ソリューション
O2	燃焼改善	焼却炉、加熱炉、燃焼炉、溶融炉等の炉出口での高温ガス中のO2測定	1500℃高温・高ダスト環境下でも測定可能	燃焼改善によるCO、CO2削減
	品質管理	製造ラインでのプロセスガス中の不純物、副産物としての低濃度O2測定	干渉無く間接的に測定可能	プロセスでの不純物ガス管理
	爆発防止	爆発防止目的としたO2の常時監視	低濃度(ppm)測定が可能	爆発抑制管理
CO	燃焼改善	焼却炉、加熱炉、燃焼炉、溶融炉等の炉出口での高温ガス中のCO測定	1500℃高温・高ダスト環境下でも測定可能	燃焼改善によるCO、CO2削減
	品質管理	製造ラインでのプロセスガス中の不純物、副産物としての低濃度CO測定	干渉無く間接的に測定可能	プロセスでの不純物ガス管理
	爆発防止	爆発防止目的としたCOの常時監視	高濃度(%)、低濃度(ppm)測定が可能	爆発抑制管理
NH3	品質管理	脱硝出口、EP出口での微量なリークアンモニア測定	低濃度(ppm)測定が可能	酸性硫安発生回避
	品質管理	COGガス/脱アンモニア前後の常時NH3監視	干渉無く間接的に測定可能	プロセスでの不純物ガス管理
	大気汚染	バイオマス排ガス中の低濃度NH3監視	高温でのNH3測定も可能	未燃アンモニア測定
H2O	燃焼改善	焼却炉、加熱炉、燃焼炉、溶融炉等の炉出口での高温ガス中のH2O測定	1500℃高温・高ダスト環境下でも測定可能	燃焼改善によるCO、CO2削減
	品質管理	製造ラインでのプロセスガス中の不純物、副産物としての低濃度H2O測定	低濃度(ppm)測定が可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	電解ラインでの塩素中の低濃度H2O測定	干渉無く間接的に測定可能	毒ガス、腐食性ガス中のH2O測定
H2S	品質管理	石油/化学でのプロセスガス中の低濃度H2S測定	低濃度(ppm)測定が可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	COGガス・バイオガス/脱硫後の常時H2S監視	腐食発生無し	
	品質管理	燃焼排ガス中のH2S濃度測定	干渉無く間接的に測定可能	腐食ガス低減対策
HCl	品質管理	石油/化学でのプロセスガス中の不純物、副産物としての低濃度HCl測定	低濃度(ppm)測定が可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	VOCガス中の低濃度HCl測定	水分多くても干渉無く間接的に測定可能	
	大気汚染	燃焼排ガス/煙道、バグフィルタ前でのHCl測定	腐食発生無し	排ガス管理
HF	品質管理	製造ラインでのプロセスガス中の副産物としての低濃度HF測定	低濃度(ppm)測定が可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	エッチングガス中、ガラス製造工程でのHF測定	干渉無く間接的に測定可能	
	大気汚染	排ガス処理後の微量HF測定(アルミニウム炉、リチウムイオン電池リサイクル)	腐食発生無し	排ガス管理
HCN	品質管理	アクリロニトリル製造ラインでのHCN測定	低濃度(ppm)測定が可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	青化ソーダ製造ラインでのHCN測定	干渉無く間接的に測定可能	
	大気汚染	排ガス処理後の微量HCN測定	腐食発生無し	排ガス管理
H2	燃焼改善	水素燃焼・混焼後の未燃H2測定	低濃度(ppm)測定が可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	電解ラインでの塩素中の低濃度H2測定	ウェットラインでも測定可能	
CO2	燃焼改善	焼却炉、加熱炉、燃焼炉、溶融炉等の炉出口での高温ガス中のCO2測定	1500℃高温・高ダスト環境下でも測定可能	燃焼改善によるCO、CO2削減
	品質管理	生石灰焼成中のCO2排ガス管理	干渉無く間接的に測定可能	プロセスでの不純物ガス管理
	大気汚染	大気中のCO2測定	低濃度(ppm)測定が可能	大気中CO2測定
CH4	燃焼改善	焼却炉、加熱炉、燃焼炉、溶融炉等の炉出口での高温ガス中のCH4測定	1500℃高温・高ダスト環境下でも測定可能	燃焼改善
	品質管理	バイオガスプラントでのプロセスガス中CH4測定	干渉無く間接的に測定可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	石油精製プラントでの水素精製中の不純物測定	低濃度(ppm)測定が可能	
C2H2	品質管理	エチレン塔出口C2H2(アセチレン)の測定	干渉無く間接的に測定可能	プロセスでの不純物ガス管理
	品質管理	ゴム製造プラントでのアセチレンリーク確認	低濃度(ppm)測定が可能	リーク対策